

集束イオンビーム・走査型電子顕微鏡加工観察装置(日本電子社製 JIB-4600F、JED-2300F)

製造元	日本電子(株)
仕様	Ga イオンビーム、二次電子像分解能 1.2 nm(加速電圧 30 kV)
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・A2棟・化学系 コアラボ
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/f6rs2o.pdf
注意事項等	
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 助教 清水雅弘 075-383-2463 shimizu.masahiro.3m (at) kyoto-u.ac.jp http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/
キーワード	ナノ構造観察、微細加工、元素分析
機器コード	(KUMaCo 稼働開始後、追記します)
自由記入欄	FIB による高速断面加工後の高分解能 SEM 観察、EDS (エネルギー分散型 X 線分析装置) による元素マッピングが可能 (オプション: 試料ピックアップシステム)

